(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-242937 (P2001-242937A)

(43)公開日 平成13年9月7日(2001.9.7)

(51) Int.Cl.'		識別記号	F	ΡI			วี	テーマコード(参考)		
G 0 5 D	3/12		G 0	5 D	3/12		s	2F078		
B 2 3 Q	1/30		B 2	3 Q	1/30			3 C 0 4 8		
G12B	5/00		G 1	2 B	5/00		T	5 F 0 3 1		
H01L	21/027		Н0	1 L	21/68		ĸ	5 F O 4 6		
	21/68				21/30		515G	5 H 3 O 3		
		審査請求	未讃求	請	マダス できゅう でんりゅう そうしゅう かいしゅう かいしゅう ひょう ひょう かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしょう かいしょう はいしょう はいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ はいしゃ	OL	(全 9 頁)	最終頁に続く		
(21)出願番号	}	特顧2000-55243(P2000-55243) 平成12年3月1日(2000.3.1)	(72) (72)	光明和光明和代理	シ 大石井 大阪井 大阪・ 大阪・ 大阪・ 大阪・ 大阪・ 大阪・ ファナ	プ大洋大株宏大株な 林阪 阪式之阪式 の式之版式8	阿倍野区長池 阿倍野区長池 社内 阿倍野区長池	町22番22号 町22番22号 シ 町22番22号 シ		

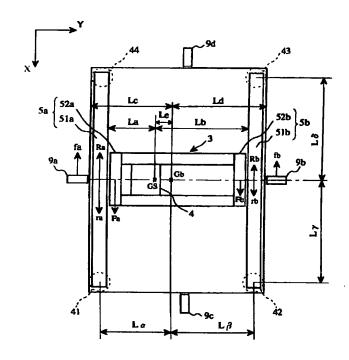
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ステージ装置

(57)【要約】

【課題】位置決め対象物やステージの重心位置が変位することに起因するヨーイング方向の偏向を防止し、位置 決め対象物を目標位置に正確に移動させる。

【解決手段】Y方向ステージ3の重心位置に応じて、Y方向ステージ3に供給する推力Fa,Fbに差異を与え、推力Fa,FbによるY方向ステージ3の重心周りのモーメントMa,Mbが互いに打ち消し合う大きさじた推力fa,fbで慣性体9a,9bをY方向ステージ3と反対方向に移動させる。推力Fa,Fbによって生じる重心周りのモーメントMa,Mbは互いに打ち消し合い、推力Fa,FbがY方向ステージ3の回転力として作用することがなく、Y方向ステージ3はヨーイング方向に偏向することがない。除振台1には、Y方向ステージ3の移動による反力に相反する反力が慣性体9a,9bの移動により作用し、除振台1がヨーイングすることがない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】ベース上に固定されたガイドを介してステージを直線状に移動させるステージ装置において、

ステージの移動方向に直交する方向における両端部のそれぞれに、ステージの重心位置に応じた推力を供給する第1推力発生手段と、

ステージに移動時に第1推力発生手段からベースに伝達 される反力に相反する力をベースに作用させる第2推力 発生手段と、を設けたことを特徴とするステージ装置。

【請求項2】前記第1推力発生手段は、ステージの移動 10 に必要な推力をFとし、ステージの重心位置から両端部のそれぞれにおける推力の作用点までの距離をLa及びLbとして、

 $Fa = F \times Lb / (La + Lb)$

 $Fb = F \times La / (La + Lb)$

により、距離La側の端部に供給すべき推力Fa及び距離Lb側の端部に供給すべき推力Fbを決定又は配分することを特徴とする請求項1に記載のステージ装置。

【請求項3】前記第2推力発生手段は、ベースにおいてステージが移動する平面に平行な平面内を移動自在にされ、ベースから推力の供給を受ける慣性体であることを特徴とする請求項1又は2に記載のステージ装置。

【請求項4】前記第2推力発生手段は、ステージが移動する平面に平行な平面内をベースに接触することなく移動することを特徴とする請求項1又は2に記載のステージ装置。

【請求項5】前記第2推力発生手段は、ベースの2カ所に配置され、ステージの移動に必要な推力をFx、ステージの重心位置からベースの重心位置までの距離をLe、第2推力発生手段における推力発生位置からベーズ 30の重心位置までの距離をLc, Ldとして、

Fc=-Fx { (Ld+Le) / (Lc+Ld) } Fd=-Fx { (Lc-Le) / (Lc+Ld) } により決定又は配分された推力Fc, Fdの供給を受けることを特徴とする請求項3又は4に記載のステージ装

置。

スの重心位置からY方向ステージの移動方向の2カ所における支持体の配置位置までの距離を $L\gamma$, $L\delta$ として、

 $F\alpha = \{L\beta/(L\alpha + L\beta)\} \{L\delta/(L\gamma + L\delta)\} W$

 $F\beta = \{L\alpha/(L\alpha+L\beta)\} \{L\delta/(L\gamma+L\delta)\} W$

 $F\gamma = \{L\alpha/(L\alpha + L\beta)\} \{L\gamma/(L\gamma + L\delta)\} W$

 $F\alpha = \{L\beta / (L\alpha + L\beta)\} \{L\gamma / (L\gamma + L\delta)\} W$

により、第 $1\sim4$ の支持体の支持力 $F\alpha$, $F\beta$, $F\gamma$, $F\delta$ を決定又は配分することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のステージ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、半導体素子等の 製造時のリソグラフィエ程に使用される露光装置、ワー クに対する機械加工に使用される工作機械、及び、測定 20 対象物の形状を測定する測定器等の精密機器に用いら れ、ワーク等の位置決め対象物を目標位置に移動させる ステージ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】位置決め対象物を目標位置に移動させる 装置として、例えば、半導体素子、液晶表示素子又は薄 膜磁気ヘッド等の製造時においてマスクパターンをウェ ハ等の基板上に転写するリソグラフィエ程に使用される 露光装置では、位置決め対象物であるウエハを所定の露 光位置に正確に位置させる必要があり、ウエハを搭載し たウエハステージ、及び、ウエハステージに対して互い に直交する2方向(X方向及びY方向)のそれぞれの推 力を供給する移動機構を含むステージ装置を備えてい る。

【0003】このように、位置決め対象物を目標位置に 正確に位置させる必要がある精密機器では、移動機構に おいて生じた推力をバックラッシュを生じることなく高 精度で位置決め対象物に供給しなければならず、また、 位置決め対象物の移動時における振動等の発生を防止す る必要もある。

【0004】そこで、従来の精密機器のステージ装置を 構成する移動機構としては一般に、固定子に対して可動 子が非接触状態で直線移動するリニアモータが用いられ ている。

力をベースに作用させる第 2 X 方向推力発生手段及び第 2 Y 方向推力発生手段からなり、X 方向ステージ及びY 方向ステージが移動する平面に平行な平面内の 4 箇所で ベースを支持する第 1 \sim 4 の支持体を設け、X 方向ステージを含むベースの重量をW、ベースの重心位置から X 方向ステージの移動方向の 2 力所に おける支持体の配置位置までの距離を L α , L β 、ベー 50

力をベースに作用させ、ステージ及び慣性体を含むベースの重心位置の移動を防止してステージに振動を生じないようにしている。

【0006】また、特開平11-168064号公報に開示された構成では、ベース上に防振台等を介して定盤を支持し、Yガイドバー及びYガイドバー搬送体を備えたXステージを定盤上においてXガイドバーに沿って移動自在に設け、このXステージをX軸リニアモータを介してX方向に駆動するとともに、X軸リニアモータの固定子を定盤上に直動ガイドを介してX方向に移動できるはうに支持し、ベースに固定された制動フレームに取り付けられたX制動部材によって、固定子に対してXステージを駆動する際の反力を打ち消すような制動力を与えるようにしている。

【0007】また、第1のYガイドバー搬送体の底面及び外側面にはそれぞれベアリングを構成する空気噴出部が設けられている。さらに、これらの空気噴出部の近傍には、磁石又は真空ポケット等の予圧機構が組み込まれており、第1のYガイドバー搬送体は、定盤の表面及びXガイドバーの側面にそれぞれ一定の間隔を保ちつつ、Z方向及びY方向に拘束されてX方向に移動できる。同様に、第2のYガイドバー搬送体の底面にもエアベアリングを構成する空気噴出部及び磁石又は真空ポケット等の予圧機構が組み込まれており、Yガイドバー搬送体も定盤の上面に一定の間隔を保ちつつ拘束されてX方向に移動できる。

【0008】この構成により、可動部の移動時にモーメントや変形力等の発生を防止し、振動を抑制することができるとされている。

【0009】さらに、特開平8-63231号公報に開 30 示された構成では、整流リニアモータを用いた可動ステ ージ装置であって、リニアモータは、ガイドレスステー ジを1方の直線運動方向に移動させ、ある平面において 微動のヨー回転を行わせるようにし、単一のポイスコイ ルモータを保持するキャリア/従動子を、直線運動方向 に動くステージを概ね追従するように制御するととも に、ポイスコイルモータは、ある平面において電磁力を 与えて直線運動方向に直交する方向にステージを微動さ せて適正なアライメントを得るようにし、さらに、整流 リニアモータの一方の要素(コイル又は磁石)を、平面 40 上を自在に動くことのできる駆動フレームの上に設け、 駆動フレームを反力によって駆動し、装置の重心位置を 維持するようにした構成が開示されている。この構成で は、1つのリニアモータを使用する場合には、2つのボ イスコイルモータを用いてヨー回転が補正される。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のステージ装置では、位置決め対象物を互いに直交する2方向について、位置決め対象物をいずれか一方向に移動させた後に残る他方向に移動させる際に、位置決め対象 50

物が駆動機構の駆動中心(駆動機構を他方向に平行なー対のリニアモータによって構成する場合にはリニアモータ間の中央の位置)に位置していない場合がある。また、位置決め対象物の形状により、移動方向である2方向にのそれぞれに直交する方向における位置決め対象物の重心位置が駆動機構の駆動中心に位置していない場合がある。このような状態で位置決め対象物を移動させると、位置決め対象物がヨーイング方向又はピッチング方向に偏向し、位置決め対象物を目標位置に正確に移動させることができなくなる問題がある。

【0011】この発明の目的は、位置決め対象物の移動時に、位置決め対象物やステージの重心位置が変位することに起因するヨーイング方向又はピッチング方向の偏向を防止し、位置決め対象物を目標位置に正確に移動させることができるステージ装置を提供すること、及び、ステージの移動による支持体の振動を抑制し、位置決め対象物を目標位置に正確に移動させることができるステージ装置を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】この発明は、上記の課題 を解決するための手段として、以下の構成を備えてい る。

【0013】(1) ベース上に固定されたガイドを介してステージを直線状に移動させるステージ装置において、ステージの移動方向に直交する方向における両端部のそれぞれに、ステージの重心位置に応じた推力を供給する第1推力発生手段と、ステージに移動時に第1推力発生手段からベースに伝達される反力に相反する力をベースに作用させる第2推力発生手段と、を設けたことを特徴とする。

【0014】この構成においては、ステージの重心位置に応じた推力がステージの両端に供給されるとともに、ステージの移動時にベースに伝達される反力に相反する力がベースに作用する。したがって、ステージの両端のそれぞれにステージの重心位置までの距離に反比例した推力を供給することにより、ステージの移動時にヨーイング方向の力がステージに作用することがない。また、ステージの移動によってベースにヨーイング方向に伝達される反力が打ち消され、ベースがヨーイングを生じることもない。

【0015】(2) 前記第1推力発生手段は、ステージの移動に必要な推力をFとし、ステージの重心位置から両端部のそれぞれにおける推力の作用点までの距離をLa及びLbとして、

 $Fa = F \times Lb / (La + Lb)$

 $Fb = F \times La / (La + Lb)$

により、距離La側の端部に供給すべき推力Fa及び距離Lb側の端部に供給すべき推力Fbを決定又は配分することを特徴とする。

) 【0016】この構成においては、ステージの両端のそ

れぞれにステージの重心位置までの距離に反比例した推 力が供給される。したがって、ステージの移動時に、ス テージがヨーイングすることがない。

【0017】(3) 前記第2推力発生手段は、ベースにお いてステージが移動する平面に平行な平面内を移動自在 にされ、ベースから推力の供給を受ける慣性体であるこ とを特徴とする。

【0018】この構成においては、慣性体が、ステージ の移動時にペースに作用する反力に応じて、ステージが 移動する平面に平行な平面内を移動する。したがって、 ステージの移動時に慣性体がベースに対して移動してス テージの移動による反力に相反する力が慣性体からベー スに作用し、ベースがヨーイング方向に回転することが ない。

【0019】(4) 前記第2推力発生手段は、ステージが 移動する平面に平行な平面内をベースに接触することな く移動することを特徴とする。

【0020】この構成においては、ステージが移動する 平面に平行な平面内においてステージの移動時の反力に 相反する力をベースに作用させることによってはベース 20 の重心位置が移動することがなく、反力に相反する力を 作用させてベースのヨーイングを制御する際に、反力に 相反する力を作用させることによるペースの重心位置の 移動を考慮する必要がない。

【0021】(5) 前記第2推力発生手段は、ベースの2 カ所に配置され、ステージの移動に必要な推力をFx、 ステージの重心位置からベースの重心位置までの距離を Le、第2推力発生手段における推力発生位置からベー ズの重心位置までの距離をLc、Ldとして、

 $Fc = -Fx \{ (Ld + Le) / (Lc + Ld) \}$ $Fd = -Fx \{ (Lc - Le) / (Lc + Ld) \}$ により決定又は配分された推力Fc、Fdの供給を受け ることを特徴とする。

【0022】この構成においては、ステージの移動によ ってペースに作用する重心周りのモーメントが、慣性体 の移動によって打ち消される。したがって、ステージの 移動時にベースの重心周りのモーメントが釣り合い、ベ 一スの重心周りのモーメントによってベースがヨーイン グ方向の回転を生じることがない。

移動するX方向ステージ及びY方向ステージからなり、 前記第1推力発生手段はX方向ステージ及びY方向ステ ージのそれぞれに供給すべき推力を発生する第1X方向 推力発生手段及び第1Y方向推力発生手段からなり、前 記第2推力発生手段は第1X方向推力発生手段及び第1 Y方向推力発生手段からベースに伝達される反力に相反 する力をペースに作用させる第2×方向推力発生手段及 び第2Y方向推力発生手段からなり、X方向ステージ及 びY方向ステージが移動する平面に平行な平面内の4箇

ステージ及びY方向ステージを含むベースの重量をW、 ベースの重心位置からX方向ステージの移動方向の2カ 所における支持体の配置位置までの距離を $L\alpha$, $L\beta$ 、 ベースの重心位置からY方向ステージの移動方向の2カ 所における支持体の配置位置までの距離を $L\gamma$, $L\delta$ と

 $F\alpha = \{L\beta / (L\alpha + L\beta)\} \{L\delta / (L\gamma + L\beta)\}$ δ) } W

 $F\beta = \{L\alpha/(L\alpha + L\beta)\} \{L\delta/(L\gamma + L\beta)\}$ δ) } W

 $F\gamma = \{L\alpha/(L\alpha + L\beta)\} \{L\gamma/(L\gamma + L\beta)\}$ δ) } W

 $F\delta = \{L\beta / (L\alpha + L\beta)\} \{L\gamma / (L\gamma + L\beta)\}$ δ) } W

により、第1~4の支持体の支持力 $F\alpha$, $F\beta$, $F\gamma$, Fδを決定又は配分することを特徴とする。

【0024】この構成においては、ベースを支持する4 個の支持体のそれぞれの支持力が、各支持体からベース の重心位置までの距離に基づいて決定又は配分される。 したがって、ステージの移動時におけるベースの重心位 置に応じて、ステージが移動する平面に直交する平面内 においてステージの移動によって生じるベースの重心周 りのモーメントが支持体の支持力により打ち消され、ベ ースがピッチング方向に回転することがない。

[0025]

10

【発明の実施の形態】図1は、この発明の実施形態に係 るステージ装置の構成を示す外観図である。ステージ装 置10は、半導体素子、液晶表示素子又は薄膜磁気ヘッ ド等の製造時においてマスクパターンをウェハ等の基板 30 上に転写するリソグラフィエ程に使用される露光装置に 適用され、ウエハを互いに直交するX方向及びY方向に おいて所定範囲内の任意の目標位置に移動させる。この ステージ装置10は、除振台(この発明のベースに相当 する。) 1の上面に構成されるX方向ステージ2、X方 向ステージ2上をX方向に移動自在にされたY方向ステ ージ3、及び、Y方向ステージ3上をX方向に直交する Y方向に移動自在にされたウエハステージ4によって構 成されている。

【0026】除振台1は、図示しない固定部上に設置さ 【0023】(6) 前記ステージは互いに直交する方向に 40 れ、外部の振動をX方向ステージ2に伝達しないための 除振構造を備えている。除振台1には、4側面のそれぞ れから突出したガイド8a~8dに外嵌する慣性体9a ~9 dが備えられている。慣性体 9 a, 9 bは、除振台 1内に備えられている駆動機構により、ガイド8a, 8 bに沿ってY方向ステージ3の移動方向と平行なX方向 に移動する。慣性体9c,9dは、除振台1内に備えら れている駆動機構により、ガイド8c、8dに沿ってウ エハステージ4の移動方向と平行なY方向に移動する。 【0027】X方向ステージ2は、X方向に平行な一対

所でベースを支持する第 $1\sim4$ の支持体を設け、X方向 50 のリニアモータ5a, 5bによって構成されている。よ

り詳細には、X方向ステージ2は、ガイド部材6a,6 bを介して除振台1の上面にX方向に移動自在にして取 り付けられたリニアモータ5a,5bの固定子51a, 51bによって構成されている。

【0028】Y方向ステージ3は、X方向に直交するY 方向に平行な一対のリニアモータ7a,7bを備えてい る。より詳細には、Y方向ステージ3は、一対のリニア モータ7a, 7bの固定子71a, 71b、及び、一対 のリニアモータ5a, 5bの可動子52a, 52bによ って構成されている。即ち、Y方向ステージ3は、所定 10 の間隔を設けて互いに平行に配置された一対のリニアモ ータ7a,7bの固定子71a,71bのY方向の両端 に、一対のリニアモータ5a,5bの可動子52a,5 2bを固定したものである。ウエハステージ4は、X方 向の両端に一対のリニアモータ7a,7bの可動子72 a,72bを固定し、上面にウエハが搭載される。

【0029】この構成により、Y方向ステージ3は、一 対のリニアモータ5a,5bから供給される推力によっ てX方向ステージ2上をX方向に移動する。また、ウエ ハステージ4は、一対のリニアモータ7a,7bから供 給される推力によってY方向ステージ3上をY方向に移 動する。Y方向ステージ3におけるウエハステージ4の Y方向の位置が変化すると、Y方向ステージ3における Y方向の重量配分が変化し、Y方向ステージ3の重心位 置がY方向に変位する。

【0030】なお、上記のように構成したステージ装置 10において、本来はウエハステージ4上に搭載される ウエハが位置決め対象物であるが、ウエハはウエハステ ージ4上の位置を固定して載置されるため、X-Y平面 におけるウエハの位置はウエハステージ4とともに変位 30 する。したがって、ウエハステージ4がこの発明の位置 決め対象物に相当し、Y方向ステージ3が同じくステー ジに相当する。

【0031】図2は、上記ステージ装置の構造を示すX 方向から見た側面図である。図2に示すように、ステー ジ装置10では、X方向及びY方向に直交するZ方向に おいて、Y方向ステージ3の重心位置とウエハステージ 4の重心位置とは、同一位置にある。また、 乙方向にお いて、リニアモータ5a,5 bにおける固定子51a, 51bの中心位置と可動子52a, 52bの中心位置と は一致しており、リニアモータ7a、7bにおける固定 子71a,71bの中心位置と可動子72a,72bの 中心位置とは一致している。この構成において、リニア モータ5a, 5bにおける固定子51a, 51bと可動 子52a,52bとの対向位置がY方向ステージ3の推 力の作用点であり、リニアモータ7a,7bにおける固 定子71a,71bと可動子72a,72bとの対向位 置がウエハステージ4の移動力の作用点である。

【0032】したがって、2方向において、Y方向ステ

用点、及び、ウエハステージ4におけるリニアモータ7 a, 7 bからの推力の作用点は、同一位置にある。この ように構成されていることから、Y方向ステージ3がX 方向ステージ2上をX方向に移動する際、及び、ウェハ ステージ4がY方向ステージ3上をY方向に移動する際 に、Y方向ステージ3及びウエハステージ4にピッチン グ方向のモーメントが作用することがない。

【0033】また、除振台1は、支持体41~44を介 して固定部45上に設置されている。支持体41~44 は、Y方向ステージ3及びウエハステージ4が移動する 平面に平行な平面内の4箇所において除振台1の底面の 4隅に配置されており、外部の振動を緩衝して振動が除 振台1に直接作用することがないようにしている。各支 持体41~44は、一例として空気バネによって構成さ れており、調圧機構によって個別に支持力を増減できる ようにされている。

【0034】図3は、上記ステージ装置の制御部の構成 を示すブロック図である。上記ステージ装置10の制御 部20は、マイクロコンピュータによって構成された制 御回路21に、変位検出センサ22、リニアモータ駆動 回路23~26、慣性体駆動回路27~30及び圧力調 整回路31~34を接続して構成されている。変位検出 センサ22は、レーザ干渉計等によって構成されてお り、Y方向ステージ3におけるウエハステージ4のY方 向の位置、及び、移動速度を検出する。リニアモータ駆 動回路 $23\sim26$ のそれぞれには、リニアモータ5a, 5b, 7a, 7bのそれぞれが接続されている。慣性体 駆動回路27~30のそれぞれには、慣性体9a~9d のそれぞれを駆動する駆動機構が接続されている。圧力 調整回路31~34のそれぞれには、支持体41~4 4 のそれぞれの支持力を調整する調圧機構が接続されてい る。また、制御回路21には、図外の入力回路を介して 目標位置データが入力される。この目標位置データは、 ステージ装置10のX-Y平面においてウエハステージ 4に載置されたウエハを位置させるべき場所を特定する データである。

【0035】制御回路21は、変位検出センサ22の検 出データに基づいてリニアモータ駆動回路23~26に 駆動データを出力することにより、リニアモータ5a、 5 b の 可動子 5 2 a , 5 2 b を 備えた Y 方向ステージ 3、及び、リニアモータ7a, 7bの可動子72a, 7 2 bを備えたウエハステージ4の移動動作をフィードバ ック制御し、ウエハステージ4に載置されたウエハを目 標位置に位置させる。リニアモータ駆動回路23~26 は、制御回路21から出力された駆動データに応じた電 流をリニアモータ5a, 5b, 7a, 7bの固定子51 a, 51b, 71a, 71bに供給する。また、制御回 路21は、リニアモータ駆動回路23~26に対する駆 動データに応じた駆動データを慣性体駆動回路27~3 ージ3におけるリニアモータ5a,5bからの推力の作 50 0に出力することにより、駆動機構を介して慣性体9a

~9 dに所定の推力を供給する。さらに、制御回路21 は、除振台1の重心位置に応じた調整データを圧力調整 回路31~34に出力することにより、調圧機構を介し て支持体41~44の支持力を調整する。

【0036】なお、変位検出センサ22は、少なくとも ウエハステージ4の位置を検出することができるセンサ

【0037】図4は、上記ステージ装置の制御部におけ る処理手順の一部を示すフローチャートである。また、 図5は同ステージ装置のステージ移動時における各部の 10 位置を示す平面図である。ステージ装置10の制御部2 0を構成する制御回路21は、目標位置データが入力さ*

$$Fa=F\times Lb/(La+Lb)$$

 $Fb=F\times La/(La+Lb)$

によって求める(104)。

【0038】これとともに、制御回路21は、Y方向ス テージ3及びウエハステージ4の位置に基づいてY方向 ステージ3及びウエハステージ4を含む除振台1の重心 位置Gbを求めた後(105)、リニアモータ5a,5 bが発生すべき推力Fa, Fbに基づいて、慣性体9 ※20

$$fa=-(Fa+Fb)$$
 { (Ld+Le) / (Lc+Ld) } · · · 式3 $fb=-(Fa+Fb)$ { (Lc-Le) / (Lc+Ld) } · · · 式4

により求める(106)。

【0039】さらに、制御回路21は、除振台1の重心 位置Gbから各支持体41~44までの距離Lα, L β, Lγ, Lδを求め (107) 、距離Lα, Lβ, L★

> $F\alpha = \{L\beta/(L\alpha + L\beta)\}\{L\delta/(L\gamma + L\delta)\}W\cdot\cdot\cdot$ 式5 $F\beta = \{L\alpha/(L\alpha + L\beta)\}\{L\delta/(L\gamma + L\delta)\}W\cdot\cdot\cdot$ 式6 $F\gamma = \{L\alpha/(L\alpha + L\beta)\}\{L\gamma/(L\gamma + L\delta)\}W\cdot\cdot\cdot\vec{\alpha}$

によって算出する(108)。

【0040】制御回路21は、上記式5~8によって求 めた支持力 $F\alpha$, $F\beta$, $F\gamma$, $F\delta$ を実現するように調 圧機構を動作させた後(109)、上記式1及び2によ って求めた推力Fa、Fbを実現する電流をリニアモー タ5a,5bに供給し、X方向についてウエハステージ 4が目標位置に達するまでY方向ステージ3を移動させ る(110、111)。これとともに、Y方向ステージ 4が移動している間において、制御回路21は、上記式 3及び4によって求めた推力fa及びfbを実現する電 40 力を駆動機構に供給し、慣性体9a,9bを移動させる (112).

【0041】上記の処理により、ステージ装置10の制 御部20は、Y方向ステージ3及びウエハステージ4を 含む除振台1の重心位置Gbに応じて支持体41~44 のそれぞれの支持力を調整した後に、Y方向ステージ3 をX方向に移動させる。このため、除振台1が安定した 状態でY方向ステージ3を移動させることができ、Y方 向ステージ3の移動によって除振台1が傾斜したり振動 したりすることがなく、Y方向ステージ3を円滑に移動 50

*れると(101)、ステージ装置10のX-Y平面にお けるウエハの現在位置と目標位置との差を算出し (10 2)、この差に基づいてリニアモータ駆動回路23~2 6を介してリニアモータ5a, 5b, 7a, 7bを駆動 する。この時、制御回路21は、Y方向についてのウェ ハステージ4の現在位置に基づいてY方向ステージ3の 重心位置GSを算出し(103)、得られた重心位置か らリニアモータ5a, 5bまでの距離La, Lbを求 め、この距離La, Lbを用いて、重心周りのモーメン トを作用させることなくY方向ステージ3を移動させる ためのリニアモータ5a,5bのそれぞれに発生させる べき推力Fa,Fbを、

> ···式1 ···式2

※a,9bに供給すべき推力fa,fbを、Y方向ステー ジ3の重心位置GSから除振台1の重心位置Gbまでの 距離をLe、慣性体9a,9bに対する推力発生位置か ら除振台1の重心位置Gbまでの距離をLc, Ldとし て、

 $★\gamma$, $L\delta$ 、並びに、Y方向ステージ3及びウエハステー ジ4を含む除振台1の重量Wに基づいて、支持体41~ 44の支持力 $F\alpha$, $F\beta$, $F\gamma$, $F\delta$ を、

 $F\delta = \{L\beta / (L\alpha + L\beta)\} \{L\gamma / (L\gamma + L\delta)\} W \cdot \cdot \cdot 38$

させることができる。

【0042】また、制御部20は、Y方向ステージ3を X方向に移動させる場合には、Y方向についてのY方向 ステージ3の重心位置GSからリニアモータ5a,5b の推力の作用点までの距離に応じて、一対のリニアモー タ5a, 5bからY方向ステージ3に供給する推力F a, Fbの間に差異を与え、推力Fa, FbによるY方 向ステージ3の重心周りのモーメントMa, Mbが互い に打ち消し合う大きさになるようにしてY方向ステージ 3をX方向に移動させる。これにより、Y方向ステージ 3に供給される推力Fa, Fbによって、Y方向ステー ジ3の重心周りに生じるモーメントMa, Mbの大きさ が互いに同一になる。したがって、モーメントMa, M bは互いに打ち消し合い、推力Fa, FbがY方向ステ ージ3の回転力として作用することがなく、Y方向ステ ージ3はヨーイング方向に偏向することがない。

【0043】さらに、制御部20は、Y方向ステージ3 が移動している間において、慣性体9a,9bをY方向 ステージ3の移動方向と反対方向に、かつ、固定子51 a,51bを介して除振台1に作用する反力に応じた推

カfa, fbで移動させる。即ち、図5に示すように、 Y方向ステージ3の両端にはY方向ステージ3の重心位 置Gsに応じた推力Fa, Fbが供給され、除振台1に は固定子51a,51bを介して推力Fa,Fbに応じ た反力Ra、Rbが作用するが、この反力Ra、Rbに 応じた推力fa,fbで慣性体9a,9bを移動させる ことにより、慣性体9a,9bの移動による反力ra, rbが除振台1に作用して反力Ra, Rbを打ち消す。 これにより、Y方向ステージ3の移動時にリニアモータ 5a, 5bの固定子51a, 51bを介して伝達される 10 反力によってペース1に生じる回転モーメントを打ち消 す力が慣性体9a,9bからペース1に作用する。これ によって、Y方向ステージ3が移動した際に、ベース1 がY方向ステージ3の移動平面に平行な平面内において ヨーイングを生じることがない。

【0044】なお、ウエハステージ4が移動範囲内の中 央に位置していること、即ち、Y方向ステージ3の重心 がY方向の中央に位置していることを条件にY方向ステ ージ3を移動させ、リニアモータ5a,5bに供給すべ き推力Fa,Fbを常に互いに同一の値となるととも に、慣性体9a,9bに供給すべき推力fa,fbを常 に互いに同一の値となるようにして、制御を簡略化して もよい。

【0045】また、ウエハステージ4がY方向に移動す る際に、Y方向ステージ3を構成するリニアモータ7 a,7bの固定子71a,71b及びリニアモータ5 a,5bの固定子51a,51bを介してベース1に反 力が伝達される。この反力によってベース1の重心周り に生じるモーメントを打ち消すように、慣性体9c,9 dをY方向に移動させる。

【0046】さらに、慣性体9a~9dを移動すること によってペース1に対して同一平面内における重心周り のモーメントを作用させるようにしているため、3個以 下の慣性体の移動に置き換えることもでき、ベース1に は少なくとも 1 個の慣性体を設けておけばよいことにな る。

【0047】また、図6に示すように、慣性体9a~9 dの移動機構をリニアモータ61等によって構成し、慣 性体9a~9dがベース1に直接接触しないようにする ことにより、慣性体9a~9dの移動によってベース1 40 の重心位置が変位することがなく、ベース1のヨーイン グを規制するための制御が容易になる。

[0048]

【発明の効果】この発明は、以下の効果を奏することが

【0049】(1) ステージの重心位置に応じた推力をス テージの両端に供給するとともに、ステージの移動時に ペースに伝達される反力に相反する力をペースに作用さ せることにより、ステージの両端のそれぞれにステージ の重心位置までの距離に反比例した推力を供給すること 50 一部を示すフローチャートである。

ができ、ステージの移動時にヨーイング方向の力がステ ージに作用することをなくしてステージを安定した状態 で移動させることができる。また、ステージの移動によ ってペースにヨーイング方向に伝達される反力を打ち消 すことができ、ベースがヨーイングを生じることをなく し、ベース上においてステージを安定して移動させるこ とができる。

【0050】(2) ステージの両端のそれぞれにステージ の重心位置までの距離に反比例した推力を供給すること により、ステージの移動時に、ステージがヨーイングす ることをなくしてステージを安定した状態で移動させる ことができる。

【0051】(3) 慣性体を、ステージの移動時にベース に作用する反力に応じて、ステージが移動する平面に平 行な平面内に移動させることにより、ステージの移動に よる反力に相反する力を慣性体からベースに作用させる ことができ、ベースがヨーイング方向に回転することを なくし、ベース上においてステージを安定した状態で移 動させることができる。

【0052】(4) ステージが移動する平面に平行な平面 内においてステージの移動時の反力に相反する力をベー スに作用させることによってはベースの重心位置が移動 することがないようにし、反力に相反する力を作用させ てベースのヨーイングを制御する際に反力に相反する力 を作用させることによるベースの重心位置の移動を考慮 する必要をなくし、ベースのヨーイングの制御を容易に 行うことができる。

【0053】(5) ステージの移動によってベースに作用 する重心周りのモーメントを、慣性体の移動によって打 30 ち消すことにより、ステージの移動時にベースの重心周 りのモーメントが釣り合い、ベースの重心周りのモーメ ントによってベースがヨーイング方向の回転を生じるこ とをなくし、ベース上においてステージを安定して移動 させることができる。

【0054】(6) ベースを支持する4個の支持体のそれ ぞれの支持力を、各支持体からベースの重心位置までの 距離に基づいて決定又は配分することにより、ステージ の移動時におけるベースの重心位置に応じて、ステージ が移動する平面に直交する平面内においてステージの移 動によって生じるベースの重心周りのモーメントを支持 体の支持力により打ち消し、ベースがピッチング方向に 回転することを確実に防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施形態に係るステージ装置の構成 を示す外観図である。

【図2】上記ステージ装置の構成を示す側面図である。

【図3】上記ステージ装置の制御部の構成を示すブロッ ク図である。

【図4】上記ステージ装置の制御部における処理手順の

【図5】上記ステージ装置におけるステージの移動時の 各部分の位置を示す平面図である。

【図6】この発明の別の実施形態に係るステージ装置の 構成を示す側面図である。

【符号の説明】

1-除振台 (ベース)

2-X方向ステージ

3-Y方向ステージ

4-ウエハステージ

5a, 5b, 7a, 7b-リニアモータ

14

51a, 51b, 71a, 71b-固定子

52a, 52b, 72a, 72b-可動子

6a,6b-ガイド部材

9a, 9b, 9c, 9d-慣性体

10-ステージ装置

20-制御部

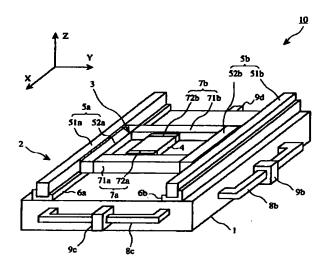
21-制御回路

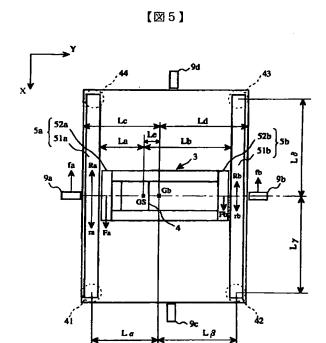
22-変位検出センサ

41~44-支持体

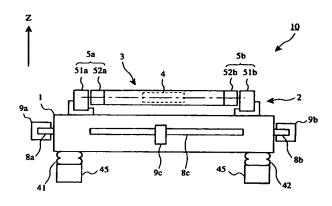
10

【図1】

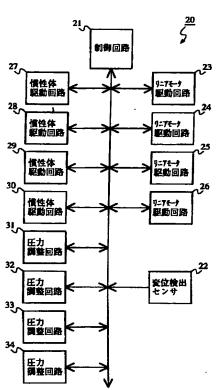




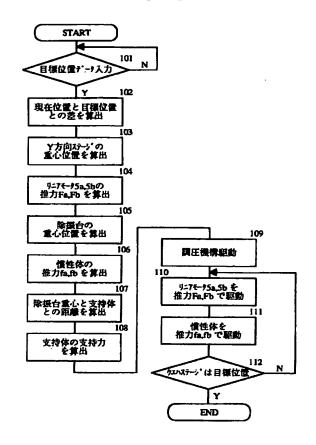
【図2】



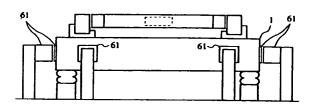
【図3】



【図4】



【図6】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

B 2 3 Q 1/30

Fターム(参考) 2F078 CA02 CA08 CB13 CC11

3C048 DD02 DD06

5F031 CA02 CA05 KA06 LA04 LA07

LA08 MA27

5F046 CC01 CC03 CC05 CC18

5H3O3 AAO6 BBO2 BBO9 BB12 BB17

CC01 DD04 EE03 EE07 FF09

GG13 HH01 QQ06